BB000

UVSOR-II の建設と立ち上げ

加藤政博 分子科学研究所 〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町西郷中38

Construction and Commissioning of UVSOR-II

Masahiro KATOH UVSOR, Institute for Molecular Science Meidaiji, Okazaki 444–8585, Japan Abstract

UVSOR has been successfully converted to UVSOR-II, which has a small emittance of 27 nm-rad and six straight sections for undulators. The reconstruction of the accelerators was completed in three months, from April to June 2003. The commissioning was started in July. On 14th July, the electron beam was successfully stored. Until the end of July, the maximum beam current reached 500 mA. In September, the operation for users has started.

1. はじめに

分子科学研究所・極端紫外光実験施設(UVSOR)は 1980年代前半に建設された第2世代の放射光リングであ る。初めてビームが蓄積されたのが1983年11月であり, 2003年は稼動開始からちょうど20年目ということになる (Fig. 1)。この節目の年に,UVSOR 光源加速器は高度化 されUVSOR-IIへと生まれ変わった。UVSOR-IIは1 GeV以下の低エネルギーの放射光リングとしては世界的 にも最高レベルの27 nm-radの低エミッタンスを実現で き、また挿入光源も最大で6台が設置可能となった。加 速器の改造は2003年春から夏にかけて3ヵ月という短期 間で完了し,その後2ヶ月間の加速器調整運転を経て9 月よりユーザー運転を再開している。以下では,UVSOR -IIの設計と建設,立ち上げ状況について報告する。

2. UVSOR 高度化計画

UVSOR はこの20年間,我が国における主要な放射光源 のひとつとして順調に稼動を続けてきた1)。光源リングの ビームエネルギーは750 MeV, 周長はおよそ50 m, 20本 の放射光ビームラインを有し、その半数は共同利用に供さ れてきた。しかしながら、その多くは偏向電磁石からの放 射光を利用するものであった。アンジュレータ2台,超 伝導ウィグラ1台が設置されていたが、アンジュレータ のうち1台は老朽化が著しく、一方、超伝導ウィグラは 施設の限られたマンパワーでは運転維持が難しく、稼働率 の低い状態が続いていた。電子ビームのエミッタンスは 160 nm-rad と,最新の第3世代光源に比べて一桁以上大 きく、またこれ以上アンジュレータを増設できるスペース も無かった。このような光源性能面での競争力の低下に加 えて、建設から20年が経過し加速器構成機器の老朽化も 深刻な問題になりつつあった。UVSOR が全国共同利用施 設にふさわしい最先端の放射光利用実験の可能な場であり 続けるためには、光源加速器の高度化を急ぐ必要があっ た。

UVSOR 施設では2000年に高度化計画を立案した²⁾。計



Figure 1. A plate commemorating the 1st beam of UVSOR in 1983.

画の柱は

- (1) 挿入光源設置可能な直線部の増設
- (2) 低エミッタンス化による放射光高輝度化
- (3) 挿入光源およびビームラインの更新による高性能化
- (4) 加速器各部の更新による高性能化, 信頼性向上

である。なるべく少ない改造で高い効果が得られ、わずか 5 名の加速器スタッフでも遂行が可能であり、改造作業に 伴う共同利用の停止期間はできるだけ短くする、といった ことを意識しながら改造計画は練られた。その概要は以下 のようなものである。

高度化計画の中心となるのは光源リングのラティス(電磁石配置)の改造である³⁾。建物の制約もあり,また,既設ビームラインへの影響を最小限にとどめるという観点からも,リングの周長,形状を変えるような改造案は排除された。偏向電磁石には変更を加えず,その間に設置されている収束電磁石の配置を変えることで,新たに4本の短い直線部(フリースペース)を作り出し,且つ,偏向電磁石中での水平ベータトロン関数,エネルギー分散関数を極小化し低エミッタンスを実現する。また直線部における垂直ベータトロン関数を極小化することで,磁極間隙の狭いアンジュレータも設置できるようにする。

最終的な光源リングの改造案は Fig. 2 に示すようなも のとなった。UVSOR の元々のラティスでは 2 台の偏向電 磁石の間に 3 台の四極電磁石と 2 台の六極電磁石が設置 されていたが,ここに1.5 m の短い直線部(フリースペー ス)を設け,その両側に四極電磁石 2 台づつを配置する。 長直線部側の 2 台づつの四極電磁石も交換しコンパクト



Figure 2. Configuration of UVSOR-II. Modification of the magnetic lattice is indicated by an arrow. The blue circles indicate the undulators and the red ones free spaces reserved for undulators.

な配置とすることで,3mであったフリースペースを4m まで拡大する。限られた空間を有効に活用するために六極 磁場は四極電磁石に設ける補助コイルにより発生する。こ れらにより直線部は,従来の3m直線部4本から,4m 直線部4本と1.5m直線部4本の合計8本へと倍増され る。高周波加速空洞,ビーム診断用装置類など,運転に不 可欠な機器を,整理し,効率よく配置することで,直線部 のうち2本はこれらの装置に占有されるものの,残りの6 本が挿入光源に利用可能となる。

ビームオプティクスは **Fig. 3**のように変わる。全ての 直線部に有限のエネルギー分散を持たせる一方,偏向電磁 石中の水平ベータトロン関数とエネルギー分散を極小化す ることでエミッタンスを従来の1/6の27 nm-rad まで小さ くする。また全ての直線部において垂直方向のベータトロ ン関数を1m程度まで小さくすることで,ビーム性能に 影響を与えることなく磁極間隙の狭い短周期アンジュレー タなどの導入が可能となるようにする。高度化前後の加速 器パラメタは **Table 1**にまとめてある。

UVSOR-IIは、小型にもかかわらず6台のアンジュ レータが設置可能であり、また、そのアンジュレータの高 輝度特性をより活かすために低エミッタンス化してある。 アンジュレータを主力とする放射光源に転換するための第 一段階として、高度化計画には、老朽化した超伝導ウィグ ラ1台、アンジュレータ1台を撤去し、替わりに2台の



Figure 3. Beam Optics of UVSOR–I (lower) and II (upper). Those for one quadrant of thering are shown.

	Table 1	Parameters	of UVSOR-I	and II
--	---------	------------	------------	--------

	UVSOR-I	UVSOR-II
Electron Energy	750 MeV	750 MeV
Circumference	53.2 m	53.2 m
Number of Super-periods	4	4
Straight Sections	$3 \text{ m} \times 4$	$4 \text{ m} \times 4$, $1.5 \text{ m} \times 4$
Emittance	165 nm-rad	27.4 nm-rad
Energy Spread	$4.2 imes 10^{-4}$	4.2×10^{-4}
Betatron Tunes (v_x, v_y)	(3.16, 1.44)	(3.75, 3.20)
Natural Chromaticity (ξ_x, ξ_y)	(-3.4, -2.5)	(-8.1, -7.3)
Momentum Compaction Factor	0.026	0.028
XY Coupling (presumed)	10%	10%

Table 2Parameters of Undulators

	BL3U	BL5U	BL7U
Туре	in-vacuum	out-of-vacuum	in-vacuum
Polarity	linear	helical/linear	linear
Number of Periods	50	18	26
Period Length	38 mm	110 mm	36 mm
Pole Length	1.9 m	2.4 m	0.94 m
Max. K Parameter*	2.0	4.6 (helical)	1.8
		8.5 (linear)	

(*Note; for the minimum gap of 15 mm in the cases of BL3U and BL7U) $\,$

真空封止型アンジュレータを導入することを盛り込んだ。 真空封止型アンジュレータは周期長を短く作れることか ら⁴⁾, UVSOR-II のような短い直線部でもある程度の周期 数を確保でき,また,UVSOR-II のビームエネルギーで も1次光で100 eV を超えることができる。高度化改造直 後には,これら真空封止型アンジュレータ2台に,既存 の円/直線可変偏光アンジュレータ1台を加えた計3台が 稼動する。アンジュレータの諸元をTable 2 に放射光ス ペクトルを Fig. 4 に示してある。加速器改造と並行して これらアンジュレータのビームラインについてもそれぞれ 高度化改造が行われる^{5,6)}。

光源リングの改造,挿入光源の更新に加えて,老朽化の 進みつつある入射器も部分的に更新を行う。電子銃及び電 源類,線形加速器のクライストロン用電源類,冷却装置な どである。特に電子銃は単バンチ入射にも対応可能な短パ ルスも発生可能なものとなる。

3. 詳細設計と機器開発

高度化計画の骨子が固まった後、ただちにハードウエア の詳細設計、テスト機の製作と性能評価を開始した。

3.1 電磁石系

今回の改造では、全ての四極電磁石、六極電磁石、ステ アリング電磁石を撤去し、複合機能型(四極/六極)の収 束電磁石32台、軌道補正用ステアリング電磁石16台を設



Figure 4. Synchrotron Radiation Spectra of UVSOR–II calculated by SPECTRA²⁰⁾. Increases in brilliance of the bending radiation and an existing undulator are indicated by arrows.

置する。収束電磁石についてはテスト機を製作し磁場測定 を行った⁷⁾。鉄心は通常の四極電磁石であるが、1台の電 磁石に3系統のコイルを設け、四極磁場、六極磁場を同 時に生成する。磁場測定の結果、必要な磁場強度が生成で きることが確認できた。

電磁石電源は、電磁石本体は再利用する偏向電磁石用も 含め、全て更新する。電源には IGBT を用いたスイッチ ング方式を採用する。電源類の制御装置として、従来のミ ニコンピュータと CAMAC を組み合わせたシステムに替 えて、ネットワークで相互に接続された PLC (programmable logic controller) とパーソナルコンピュータで構成 される簡便なシステムを構築する。ビーム位置モニター系 と接続することで軌道安定化が行える機能も組み込む。

UVSOR は建設来電磁石の精密測量を行っておらず,また,その後の機器の設置などにより建設当初の測量機器類 は使用できなくなっていることがわかっていた。事前に電 磁石位置の現状を把握し,また,測量方法を確立しておく ために,2001年春にリングの精密測量を試行した。軌道 面内の電磁石の位置については自動追尾型のレーザー測距 装置を,また鉛直方向については精密光学レベルを用い て,測量できることを確認した。

3.2 真空系

高度化ではリングの約2/3の真空ダクトを更新する^{8.9}。 真空ダクトは従来どおりステンレス製とした。従来は偏向 部以外は冷却されていなかったが,将来の電流値増加など を想定して,放射光が照射される部位は基本的に全て水冷 できるようにした。チタンサブリメーションポンプとスパ ッタリングイオンポンプの組み合わせからなる排気装置は 2 台の四極電磁石の間にコンパクトに組み込み,各直線部 に2 セットづつが設置される。偏向部のダクトのうち2 本は新しいアンジュレータ用ビームラインの設計に合わせ て,また別な1本は赤外線ビームラインの高度化に合わ せて新たに設計したものに更新する。これらについては従 来の分布型イオンポンプに加えてチタンゲッターポンプを 備え排気能力を増強してある。アンジュレータラインに対 応する2台にはビームライン用の放射光取り出しポート に加えて電子ビーム診断用の光取り出しポートを設けた。 偏向ダクトはダクトに直接電流を流して加熱することで ベーキングを行っていたが,偏向ダクトを電気的に絶縁す るために,ダクトの各所にセラミックスが挿入されてい た。これらはビームの電気的ノイズの外部への漏れ,ビー ム不安定性,真空リークなどの原因となる恐れがあるた め,この機会に一掃することにした。既設のものも含め偏 向ダクトには全てヒーターと断熱材を取り付け,通常の方 式でベーキングが行えるようにした。

3.3 アンジュレータ

真空封止型アンジュレータについては、光源リング改造 に先行して、磁石長約1m、周期長36mm、周期数26周期 のものを製作し、2002年春に超伝導ウィグラを撤去した 跡地に設置した(Fig. 5)¹⁰⁾。試験運転の結果、磁石列の ビームへの影響も特に観測されず、磁石間隙とビーム寿命 の関係も予測と概ね一致し、この種のアンジュレータが UVSOR のような低エネルギーのリングでも問題なく使用 できることが実証できた¹¹⁾。また新しいアンジュレータ 制御システムを構築し動作試験を行った。コントロール 室、ビームラインの双方からの運転が可能であり、磁極間 隙変更に伴う軌道の変化もリング全周で数ミクロン以内に 補正できることが確認できた¹²⁾。2台目の真空封止型アン ジュレータについては利用グループとの協議の結果、周期 長38 mm、50周期で磁極長約2mと1号機の約2倍の長 さのものを製作することとなった。

3.4 高周波加速系

UVSOR 高度化では電子ビームの低エミッタンス化に伴



Figure 5. 1st In-vacuum undulator for BL7U.

い Touschek 効果によりビーム寿命が制限されることが予 想された。これを防ぐには高周波加速系の増強が必要であ るが、その第一弾として、それまで高周波加速空洞の投入 電力を制限してきた入力カプラーの交換を2002年春に行 った¹³⁾。従来のもので見られた発熱は大幅に低減され、 投入電力を30%程度上げた試験運転では特に問題は見ら れなかった。ただし、空洞本体は老朽化が進んでおり、空 洞内部での電力損失が大きいなどの問題もあるためリング 改造後の適当な時期に更新することとした。

3.5 ビーム計測系

UVSOR-IIの高輝度特性を十分に引き出すためには軌 道の安定化が重要である。従来の偏向電磁石ダクトに設け られているビーム位置検出器は,放射光照射によるダクト の熱変形などの影響を受けるため,軌道の動きを正確に捉 えていない可能性があった。高度化改造に際して8台の ビーム位置検出器を長直線部の両端に設置することとし た。これら新旧の検出器の信号は,高度化に先行して 2001年に構築されたビーム収集系によりまとめて処理す ることで,1秒毎の軌道を数ミクロンの精度で計測するこ とができる¹⁴⁾。これら電子ビーム位置モニターに加え て,放射光位置モニターも,高度化改造に先行して2002 年夏にビームライン BL7B に設置した¹⁵⁾。

従来,計4箇所に設けられていたビーム診断用光取り 出しポートはアンジュレータ設置用スペースの確保のた め、全て撤去され、その替わりに、新たに製作する偏向電 磁石ダクト2台にビーム診断用光取り出しポートを1台 づつ設ける。これらはビームプロファイル観測、バンチ純 度測定などに利用される。

ビームを強制振動させるための RFKO 装置はビーム診 断用と filling pattern 制御用の2 つが設置されていたが, スペースの有効利用のため,後者を両方の目的に使用でき るよう2002年に改良を施し¹⁶⁾,残りの1 台は撤去するこ ととなった。蓄積ビームを削り落とすためのビームスク レーパは,老朽化が進んでおり機能も貧弱であったので更 新する。

3.6 入射器

UVSOR の入射器は15 MeV の線形加速器と600 MeV のブースターシンクロトロンからなるが、今回の高度化改 造では、線形加速器の部分更新を行うこととした。具体的 には電子銃及び駆動電源類、クライストロン用パルス変調 器、冷却水循環装置などである。電子銃は単バンチ入射が 可能な短パルスも生成できるものとなる。

4. 加速器改造

UVSOR 高度化計画は,幸い,2002年度に予算化された。2002年度末までに必要な装置の製作を完了し,2003年4月から6月の3ヶ月で完了,7,8月の2ヶ月で立ち上げ調整を終え,9月から共同利用を再開する,というスケジュールが組まれた。



Figure 6. 2nd In-vacuum undulator for BL3U.



Figure 7. Injection linac under reconstruction.

2003年3月末に旧UVSORでのユーザー運転を終了 し、加速器改造のための約3ヶ月のシャットダウンに入 った。加速器の改造では、まず、高周波加速空洞などごく 一部を除くリングのほぼ全周を大気開放した。全てのビー ムラインの真空系は一旦リングと切り離した。その後、偏 向電磁石など再利用する機器を除く全ての機器と配線配管 類の撤去が始まった。建設後20年が経過し正体のわから ないケーブル類なども大量に見つかったが、一本一本追跡 し、不要なものは撤去した。床面の補修などを行った後、 新しい電磁石を搬入し1mm以内程度の粗い精度での据え 付けをおこなった。その後、電磁石類を半分割し真空ダク トを据え付けた。これらと並行して電源類の据付、配線・ 配管,真空封止型アンジュレータ2号機の据え付け (Fig. 6)、入射器の更新(Fig. 7)も行われた。

真空ダクト据え付け完了後,全ての電磁石を±100ミク ロン以内の位置精度で精密に据え付けた。測量は前述した レーザー測距装置と精密光学レベルを用いる手法で行っ た。真空ダクトはリング1周を接続し,真空引きした 後,最高200℃でおよそ1週間かけて加熱排気処理を施し た。これら全てが終わり光源リング運転再開の準備が整っ たのは7月の第1週である。改造完了後のリングの様子



Figure 8. UVSOR-II Storage Ring and Beam-lines just after the reconstruction.

を Fig. 8 に示す。

5. UVSOR-II の立ち上げ

2003年7月の第1週にリングに先行して,入射器の調 整運転を開始した。開始当日はシンクロトロンへの入射条 件を見失って慌てたが,二日目には入射と600 MeV への 加速に成功した。線形加速器からシンクロトロンへの入射 効率は大幅に改善され,改造前と比べておよそ3倍程度 の強度の電子ビームを加速できるようになった。線形加速 器の更新の効果が現れたものと考えている。入射器が極め て好調に立ち上がったことが引き続き行われた光源リング の立ち上げにも好影響を与えた。

7月第2週から光源リングの運転を開始した。しかしす ぐにビームが蓄積できたわけではなかった。シンクロトロ ンからはビームはちゃんと来ている。リングに入射された ビームは何千回も周回しているのが計測システムにより確 認できる。しかし何故か蓄積されない。調べて見ると, ハードウエアに関係する問題が複数見つかった。これらを ひとつひとつ取り除いて7月14日に運転を再開したとこ ろビームの蓄積に成功した。その1週間後にはビーム強 度が,放射線管理上UVSORに許可されている上限値で ある500 mA に達するようになった。また同じ日に750 MeV への加速にも成功した。7月30日には低エミッタン スモードでの入射蓄積にも成功した。

ユーザー運転をスケジュールどおりに再開することを最 優先に調整を進めたために,光学関数,エミッタンスなど の基本的なパラメタの測定は後回しになっている。ベータ トロンチューンやエネルギー分散の測定結果は,光学関数 が概ね設計どおりであることを示しており,目標のエミッ タンスは達成できているものと考えている。エミッタンス 確認のため,現在,放射光の可視光成分を用いたビーム診 断ステーションを立ち上げ中である。

8月に入ってからは一日あたり約12時間の運転時間の半 分を真空度改善のための大電流運転に,残りの半分をビー ムライン側へ放射光を取り出しての立ち上げ調整に充て



Figure 9. Improvement in beam lifetime during the first one month. Lifetime multiplied by beam current is illustrated versus time integrated beam current. The normal beam lifetime before the upgrade was around 1000 mA*hr.

た。今回の改造ではリングの大半の真空ダクトが新品にな り、また、更新しないものも長期間大気にさらされた。こ のため運転再開直後は放射光がダクト内壁に照射されるこ とで激しい脱ガスが起き、真空の悪化でビームの寿命は非 常に短くなった。これは新しい加速器あるいは大きな改造 をした加速器の立ち上げでは避けて通れない問題であり、 これを解決するには電子ビームをどんどん回して、放射光 の照射を続け、脱ガスを促し、ダクトが真空的に涸れてく れるのを待つしかない。運転開始から最初の1ヶ月間で のビーム寿命の回復の様子を Fig.9に示す。着実に回復 していることがわかる。

9月第1週,当初の予定通りユーザー運転を再開した。 真空は回復しつつあるとはいえ改造前のレベルに到達する には何ヶ月かかかることが予想されたため、少しでも寿命 を延ばすためにエミッタンスはやや大きめの約60 nm-rad とし Touschek 効果を緩和している。入射間隔も改造前の 6時間に対して4時間と短くしてある。今後ビーム寿命の 回復を待って,低エミッタンスモードでの運転に移行し, また,運転間隔も延ばしていく予定である。

新しいアンジュレータの立ち上げ調整は週1回の光源 開発用の運転時間を利用して進めている。磁極間隙をビー ム性能に影響を与えることなく目標値まで小さくできるか どうかが重要であったが、2台とも目標の最小磁極間隙15 mm までの範囲内で特に問題なく運転できることが確認で きている。ビームラインの光軸調整,利用者からの磁極間 隙の随時変更を可能とするための制御系の調整を進めてい る段階である。

6. まとめと展望

UVSOR 高度化計画は当初のスケジュール通りに、リン

グの大半に及ぶ大改造をわずか3ヶ月で完了し,その後2 ヶ月のビーム調整期間でユーザー運転の再開までこぎつけ ることができた。目標とした低エミッタンスでのビーム運 転も既に成功し,新しいアンジュレータ2台の立ち上げ も順調に進んでいる。これまでのところ高度化された光源 リング UVSOR-II は極めて順調に立ち上がったといえ る。今後は,ビーム電流値,ビーム寿命の改良,軌道安定 化など,時間のかかる課題に取り組んでいくことになる。 ビーム寿命については短期的には高周波加速系の増強で対 応することになるが,長期的にはいわゆるトップアップ運 転も検討する必要があると考えている。

アンジュレータは現在3台が設置され,あと3台の増 設が可能である。そもそもUVSOR高度化計画は,アン ジュレータ中心の光源への転換が目的であったが,その意 味では,残り3台のアンジュレータの建設・導入とビー ムラインの整備が完了して,初めて,目的を達したといえ る。現在はそのための土台ができた段階である。今後も立 ち止まることなく,UVSOR-IIの特長が活かせるような アンジュレータとビームラインの整備を利用者と協議しな がら進めていくことが重要であると考えている。

UVSOR-IIの低エミッタンスと長くなった直線部は, UVSORで長年行われてきた自由電子レーザー開発におい ても、より短波長域での発振、高調波発生など、新たな展 開をもたらす可能性がある¹⁷⁾。また、レーザーと電子 ビームの相互作用を利用した新しい光発生法の開発^{18,19)}な ど、高性能でありながら小型で小回りのきく加速器の特長 を活かした光源開発も進めていきたいと考えている。

謝 辞

UVSOR-II の建設と立ち上げは小杉信博施設長以下, UVSOR 職員全員によって行われたものである。本計画の 実現にあたって、分子科学研究所茅幸二所長には様々な形 で支援をいただいた。加速器の機器開発は, KEK, SPring-8など、外部の研究者の支援を得て行われたものも多 い。真空封止型アンジュレータの設計開発は、平成12、 13年度分子科学研究所共同研究として、理化学研究所 (SPring-8) 北村英男, 原徹, 田中隆次の各氏の協力を得 て行われた。ビーム位置検出システムの開発は、平成12 年度分子科学研究所共同研究として、高エネルギー加速器 研究機構本田融氏の協力を得て行われた。真空系の設計 は、高エネルギー加速器研究機構堀洋一郎氏(平成13, 14年度分子科学研究所客員助教授)の協力を得て進めた。 高周波加速系に関しては高エネルギー加速器研究機構の斎 藤芳男,春日俊夫,坂中章吾の各氏に貴重な助言をいただ いた。高エネルギー加速器研究機構の芳賀開一氏にはビー ム位置検出器の設計に協力していただいた。理化学研究所 の小関忠氏には真空封止型アンジュレータ真空槽の設計に 協力していただいた。佐賀県立九州シンクロトロン光研究 センターの江田茂氏(平成13年まで分子科学研究所在籍)

にはビーム計測系の構築に協力していただいた。名古屋大 学の高嶋圭史氏(平成14年まで分子科学研究所流動部門 在籍)にはマシンスタディ,放射線遮蔽の検討などに協力 していただいた。計画に参加された全ての方々,支援して くださった全ての方々に感謝します。

参考文献

- 1) e.g. M. Kamada et al.: J. Synchrotron Rad. 5, 1166 (1998).
- 2) 加藤政博:「放射光」第14巻第4号27(2001).
- 3) M. Katoh et al.: Nucl. Instr. and Meth. A 467-468, 68 (2001).
- e.g. H. Kitamura: Proc. 25th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop: "Shanghai Symposium on Intermediate-Energy Light Sources" 206–210 (2002).
- 5) T. Hatsui et al.: presented at SRI'03 (San Francisco, 2003).
- 6) Y. Nonogaki et al.: presented at SRI'03 (San Francisco, 2003).
- J. Yamazaki et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR-29 39 (2002).
- 8) Y. Hori et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR–30 46 (2003).
- J. Yamazaki et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR-30 48 (2003).
- 10) A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR –29 47 (2002).
- A. Mochihashi et al.: presented at 8th Internat. Conf. Synch. Rad. Instr. (San Francisco, 2003).
- K. Hayashi et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR-30 50 (2003).
- 13) A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity report 2002, UVSOR -30 44 (2003).
- 14) K. Hayashi et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR-29 37 (2002).
- A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR -30 42 (2003).
- A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR -30 39 (2003).

- 17) M. Hosaka et al.: presented at 2003 FEL Conference (Tsukuba, 2003).
- Y. Takashima et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR –29 43 (2002).
- Y. Takashima et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR -30 56 (2003).
- T. Tanaka and H. Kitamura: J. Synchrotron Rad. 8, 1221– 1228 (2001).



加藤政博

分子科学研究所極端紫外光実験施設• 助教授

高エネルギー加速器研究機構物質構造 科学研究所・助教授(客員研究部門) E-mail: mkatoh@ims.ac.jp 専門: 加速器科学

略歴:

1986年に高エネルギー物理学研究所放射光実験施設 (Photon Factory)に助手として着任。以降,放射光源加 速器を対象とした研究を続けている。2000年3月より現 職。現在,物質構造科学研究所助教授(客員部門)を併任 中。

これまでに PF リングの高輝度化計画, UVSOR の高度 化計画と比較的大きなプロジェクト 2 つを,設計からコ ミッショニングまで一貫してやらせていただき,チャンス に恵まれたと言えなくもないが,実は,新品の加速器とい うのは一度も作ったことがない。いつの日かそのような仕 事をやってみたいものである。また今後は,加速器本体に 関する仕事と並行して,相対論的な電子ビームを用いた様 々な光発生法に関する研究も行っていきたいと考えている。